

(414) 超高真空走査型電子顕微鏡による Ti-N 膜中 N の定量分析

川崎製鉄株式会社 鉄鋼研究所

○北野葉子 締引純雄

工博 清水真人

1. 緒言

Ti-N コーティング膜は耐摩耗性、装飾性に優れ広く利用されている。走査型電子顕微鏡（以下 SEM）は、膜の評価や微小部、断面観察に欠かせないが、観察と同時に EDS による簡便な元素分析も一般的になってきた。最近では UTW-EDS によって C、O、N 等軽元素の検出も可能であるがこれらは定性分析がほとんどである。そこで当研究所の超高真空 SEM を用いて Ti_{Nx} 膜中 N の UTW-EDS による定量法を検討した。

2. 装置

用いた装置は以下の仕様の超高真空 SEM である。

測定室の真空度： 3×10^{-7} Pa / オイルフリーな排気系 / Lab₆ 電子銃

EDS : Kevex 7000 UTW-EDS

3. 試料

鋼板に厚さ約 1 μm イオンプレーティングした Ti_{Nx} と Ti を用いた。

N₂ガス量と圧力変化で N 濃度をふらせ、化学分析値を Table 1 に示した。

4. 測定条件及び結果

加速電圧 10KeV、ビーム電流約 2.0 nA (ファラデーカップ) の条件で、一試料につき 5 点ポイント分析した。試料はエタノールで超音波洗浄後 Ar スパッターで表面汚れを除いた。試料は長時間ビームを照射しても黒い跡がつかず、C ピークも出ない。

EDS はエネルギー分解能が悪く、Fig 1 に示すように TiL 線と NK 線が完全に重なる。付属のピーク分離ソフトでは Fig 2 の▲印に示すように N 濃度に対する N 強度の勾配は低く原点を通らない。これは TiL 線ピークの拡がり、ピーク中心の La テーブル値*からはずれ、TiL と NK のエネルギー位置の近接によるピーク分離不良のためである。そこで重合ピークから TiL を直接引く方法を用いた。同時に測定した TiK で規格化した純 Ti の TiL を重合ピークから引くと Fig 1 に示す NKA Table 値*に合うピークを得た。

ガウス分布にフィッティング後 N 強度とすると Fig 2 に●印で示す様に原点を通る直線が得られ、No. 4 を標準試料に MAGIC VZA F で定量すると Fig 3 の良好な結果を得た。共存元素の L 線が重なる場合も適当なピーク分離で軽元素定量ができるとわかった。

* NKA₁ : 392 eV, TiLa₁ : 450 eV (EDAX EPIC TABLES)

Table 1 Chemical compositions.

sample	1	2	3	4	5	6	Ti
N wt%	14.7	15.4	18.9	20.7	21.1	23.5	—
Ti wt%	85.3	84.3	81.1	79.3	78.9	76.5	100 ^s

s nominal

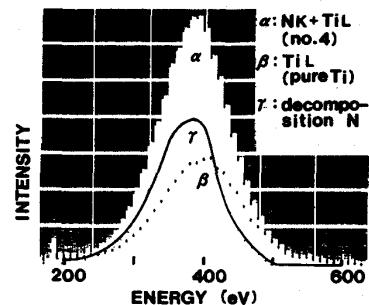


Fig 1 EDX spectra of Ti_{Nx}, Ti and decomposition N.

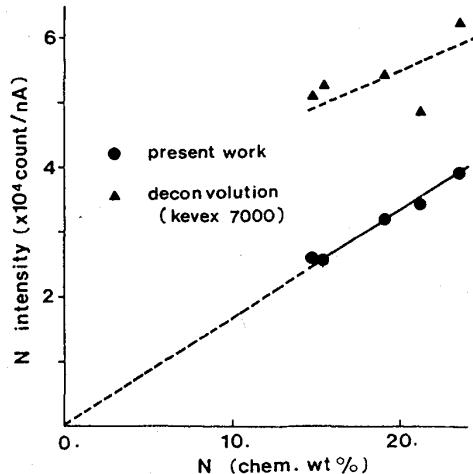


Fig 2 Correlation between N intensities and N compositions.

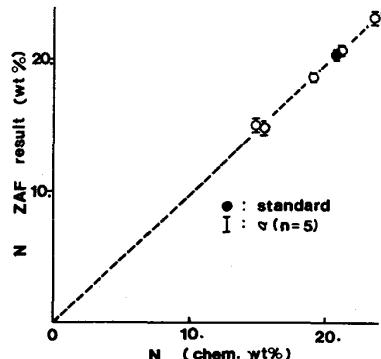


Fig 3 Correlation between N ZAF calculations and N compositions.